

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第2区分
 【発行日】平成17年10月6日(2005.10.6)

【公開番号】特開2002-361370(P2002-361370A)
 【公開日】平成14年12月17日(2002.12.17)
 【出願番号】特願2002-113367(P2002-113367)
 【国際特許分類第7版】

B 2 2 C 21/14
 B 2 2 C 7/02
 B 2 2 C 7/06
 B 2 2 C 9/04
 F 0 1 D 5/18

【F I】

B 2 2 C 21/14 A
 B 2 2 C 7/02 1 0 3
 B 2 2 C 7/06
 B 2 2 C 9/04 K
 B 2 2 C 9/04 R
 F 0 1 D 5/18

【手続補正書】

【提出日】平成17年5月27日(2005.5.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

セラミックの中子にロケータ要素を成形する方法であって、前記中子に近接する複数のロケータ-成形穴を有するダイの穴にセラミックの中子を配置することと、及び前記中子の表面に複数のロケータ要素を成形するために各ロケータ-成形穴への流動物質の導入からなることを特徴とする方法。

【請求項2】

前記流動物質が、溶解されたワックスであることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項3】

セラミックの中子にロケータ要素を成形する方法であって、前記中子に近接する内部末端上のロケータ-成形穴を有する各ピンを伴う複数のピンを有するダイの穴にセラミックの中子を配置することと、及び前記中子の表面に複数のロケータ要素を成形するために各ロケータ-成形穴への流動物質の導入からなることを特徴とする方法。

【請求項4】

前記流動物質が溶解されたワックスからなり、及び前記ロケータ-成形穴に導入されて、前記ロケータ要素を成形するために凝固されることを特徴とする請求項3に記載の方法。

【請求項5】

前記中子が、第一ダイの部分で複数の前記ピンに面する凹状エーロfoil表面及び第二ダイの部分で複数の前記ピンに面する凸状表面の中子表面を含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。

【請求項6】

セラミックの中子にロケータ要素を成形する装置であって、該装置が、ダイの穴と、前記中子に近接する内部末端上のロケータ - 成形穴を有する各ピンを伴うダイの穴の複数のピンと、前記中子の表面に面する各前記ロケータ - 成形穴と、及び前記中子の表面に複数のロケータ要素を成形するようにそれぞれのロケータ - 成形穴へ流動物質を導入するための径路とからなることを特徴とする装置。

【請求項 7】

前記ダイの穴が、凹状のエーロfoil表面及び凸状のエーロfoil表面を含むことを特徴とする請求項 6 に記載の装置。

【請求項 8】

前記中子のそれぞれの凹状のエーロfoil表面と前記中子の凸状のエーロfoil表面が面するように、複数の前記ピンが前記凹状のエーロfoil表面に配列され、別の複数の前記ピンが前記凸状のエーロfoil表面に配列されることを特徴とする請求項 7 に記載の装置。

【請求項 9】

エーロfoilの鑄造で使用するためのセラミックの中子であって、該中子は、凹状中子表面及び凸状中子表面からなり、前縁及び後縁によって接続され、第一のロケータ要素が一時的な物質の前記凹状表面で鑄造され及び第二のロケータ要素が前記一時的な物質の前記凸状表面で鑄造され、前記第一及び第二のロケータが前記凹及び凸状中子表面上に鑄造された前記一時的な物質のストリップによって接続され、少なくとも一つの前記前縁及び前記後縁の周辺を包んでいることを特徴とするセラミックの中子。

【請求項 10】

前記第一のロケータ及び第二のロケータ要素が、前記凹状表面から前記凸表面に向かう方向で整列されることを特徴とする請求項 9 の中子。